



ZEISS O-INSPECT duo

Pierwszy system multi technologiczny ZEISS:
mikroskop i współrzędnościowa maszyna pomiarowa



Seeing beyond

ZEISS O-INSPECT duo

Metrologia i mikroskopia w duecie

ZEISS O-INSPECT duo łączy dwie technologie w jednym produkcie i zapewnia narzędzie zarówno dla mikroskopii, jak i metrologii zarówno optycznej jak i stykowej.

Połączenie systemu ZEISS ZEN core i oprogramowania metrologicznego ZEISS CALYPSO w jednej maszynie multisensorowej dostarcza wyjątkowych korzyści i pomaga zautomatyzować procesy, usprawnić konfigurację systemu i dokumentację wyników.

Rozwiązanie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, wszędzie tam, gdzie części są płaskie i wymagają pomiaru stykowo-optycznego lub gdy potrzebny jest jednocześnie pomiar i inspekcja powierzchni.



Przykłady zastosowania

Motoryzacja

- folia akumulatorowa
- stosy ogniw paliwowych
- piny silnika elektrycznego

Przemysł elektroniczny

- płytki drukowane
- wyświetlacze
- łączenia
- piny

Komponenty medyczne

- implanty stawu kolanowego
- śruby ortopedyczne
- implanty dentystyczne

Informacje techniczne

Specyfikacja	ZEISS O-INSPECT duo
Rozmiar/zakres pomiarowy w mm	800×600×300
Obiektyw	ZEISS Discovery.V12 scout 160 c kamera kolorowa 5 MP, 2464×2056 pikseli
Oświetlenie	16 segmentów w pierścieniu LED światła białego, koncentryczne światło przechodzące i odbite
Dystans roboczy w mm	55
Zoom optyczny	12×
Pole widzenia w mm	10,48 x 8,6 (max.)
Głowica stykowa	ZEISS VAST XXT – TL1/TL3
Dokładność pomiaru	1D: 1,5 μm + L/250 2D: 1,8 μm + L/250 μm 3D: 2,2 μm + L/250 μm
Oprogramowanie	ZEISS CALYPSO (przy zastosowaniach metrologicznych) ZEISS ZEN core (przy zastosowaniach mikroskopowych)
Nośność stołu	do 100 kg



Najważniejsze cechy i zalety

1 System typu 2-w-1

ZEISS O-INSPECT duo to system do wielu zastosowań, który łączy w sobie funkcjonalności dwóch urządzeń: współrzędnicowej multisensorowej maszyny pomiarowej i mikroskopu.

2 Duże pole widzenia i obszar pomiarowy

Ze względu na swoje wymiary (zakres pomiarowy 800 × 600 × 300 mm) ZEISS O-INSPECT duo to rozwiązanie do inspekcji dużych części lub pomiarów równoległych wielu małych części.

3 Dwa systemy operacyjne

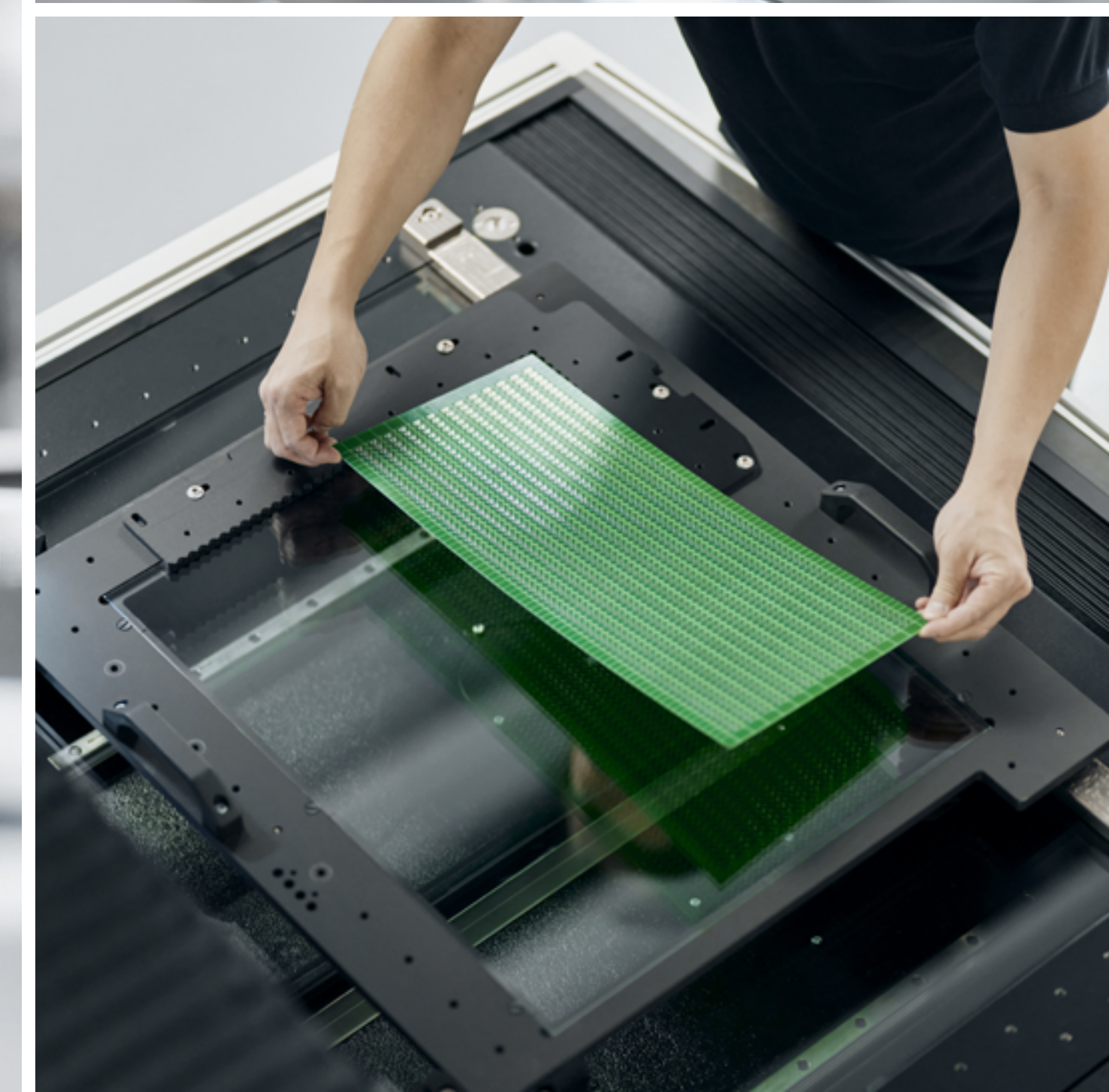
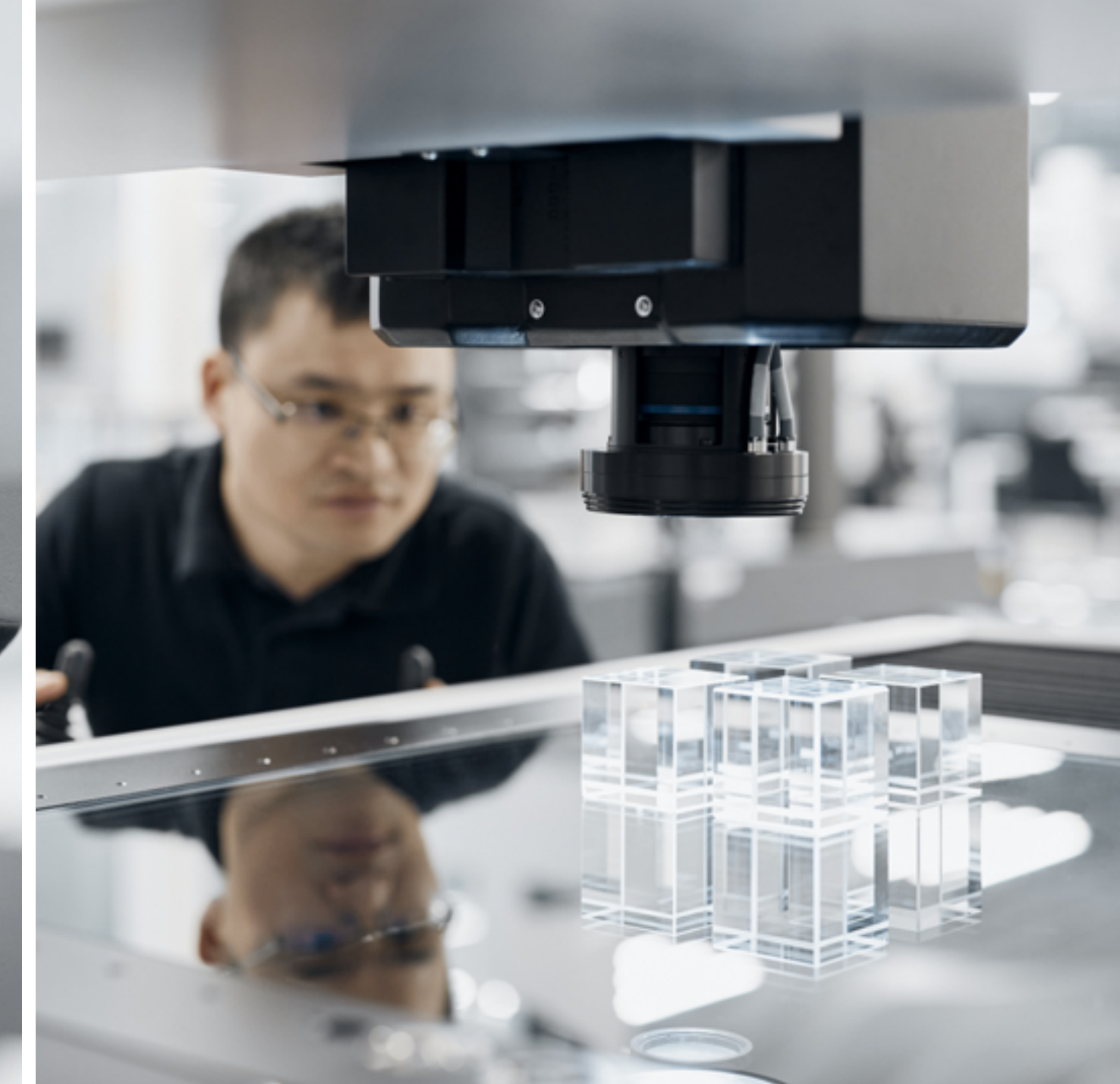
Includes two specialized softwares for each task: ZEISS CALYPSO for metrology and ZEISS ZEN core for microscopy.

4 Zoptymalizowane procesy

By performing measurement and inspection tasks on the same device, you can reduce setup times, lower maintenance and open floorspace in the facility.

5 Wyjatkowa jakość obrazowania

The new 5 MP color camera with ZEISS scout 160 optics offers a high resolution with multiple magnification levels for capturing even the smallest details.



Najważniejsze cechy i zalety

6 Zautomatyzowane procesy

W pełni zautomatyzowane pomiary i inspekcja, obrazowanie i komplectacja dokumentacji dla czynnici lub pomiarów seryjnych przy zachowaniu dużej przepustowości.

7 Elastyczne podejście do pomiarów dzięki wymianie głowic

ZEISS O-INSPECT duo to maszyna multisensorowa co oznacza, że ma możliwość wymiany głowicy optycznej na stykownik ZEISS VAST XXT, która umożliwia skanowanie z wysoką dokładnością.

8 Wysoka dokładność

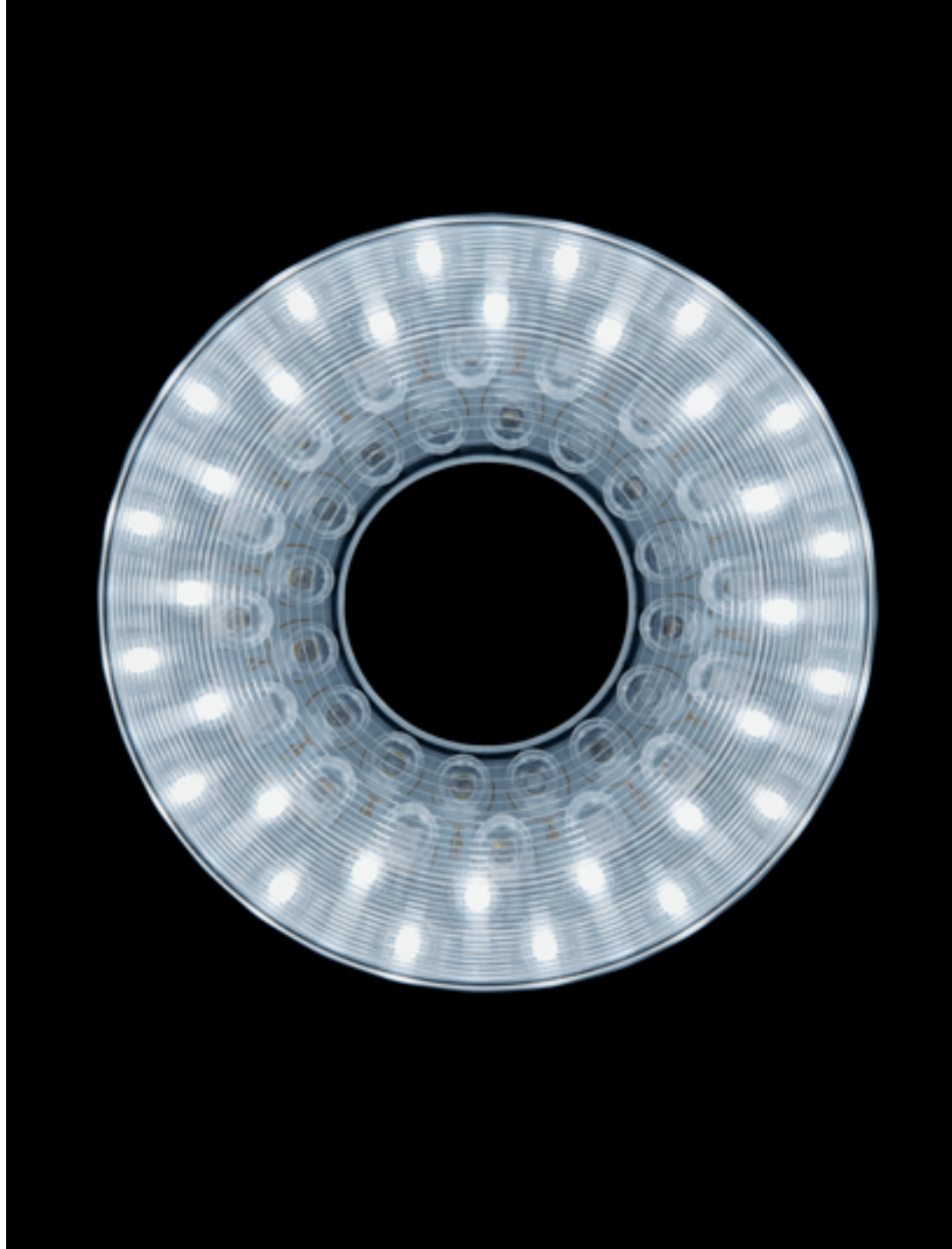
Based on MPE E0 (3D) from ISO-10360, ZEISS O-INSPECT duo promises reliable measurement results and ensures global comparability with an accuracy from $1,5 \mu\text{m} + L/250 \mu\text{m}$.

9 Efektywność cenowa

Due to the 2-in-1 technology the machine offers a sustainable and cost efficient solution as the system and service costs are lower in comparison to two machines.

10 16-segmentowe oświetlenie LED

With 16-segment LED ring light with white LEDs, coaxial uplight and backlight for different measuring tasks and high-contrast images.



Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami po więcej informacji
lub aby umówić prezentację systemu

[Formularz kontaktowy](#)





Seeing beyond